# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representation of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

1/9/3 DIÁLOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv. \*\*Image available\*\* 011794945 WPI Acc No: 1998-211855/ 199819 XRAM Acc No: C98-067003 XRPX Acc No: N98-168298 Optical recording medium - comprises a substrate bearing at least a recording layer and a reflecting layer. The recording layer contains the azo-compounds Patent Assignee: MITSUI TOATSU CHEM INC (MITK ) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001 Patent Family: Week Applicat No Kind Date Patent No Date Kind 19980303 JP 96216181 Α 19960816 199819 B JP 10058828 Α Priority Applications (No Type Date): JP 96216181 A 19960816 Patent Details: Main IPC Filing Notes Patent No Kind Lan Pg 31 B41M-005/26 JP 10058828 Α Abstract (Basic): JP 10058828 A Medium comprises a substrate bearing at least a recording layer and a reflecting layer. The recording layer contains the azo-compounds of formula (1-1), which has absorption max. at wave-lengths 450 - 630nm, or its metal complex, and has ability of recording and reproduction for the laser beam selected from wave- lengths of 520 - 690nm; Formula (1-1) - P in (1-1), R1, R2 = H atom, (substd.) alkyl, (substd.) aryl, (substd.) aralkyl or (substd.) alkenyl gp.; R3-6 = H, halogen atom, hydroxy, carboxyl, sulphon, sulphonamido, amino, (substd.) aryl, (substd.) acyl, (substd.) alkylcarboxyl, (substd.) aralkyl, (substd.) alkylcarbonylamino, (substd.) alkylsulphonamino, (substd.) alkylamino, (substd.) alkylsulphon, (substd.) alkenyl gp., [when metal complex is formed here, one of R5 and R6 is hydroxy, carboxyl, amino, (substd.) alkylcarboxyl, (substd.) alkylcarbonylamino, (substd.) alkylsulphonamino or (substd.) alkylamino gp. and the other is H, halogen atom, hydroxy, carbox- yl, sulphonamido, amino, (substd.) aryl, (substd.) acyl, (substd.) alkylcarboxyl, (substd.) aralkyl, (substd.) alkylcarbonylamnio, (substd.) alkylsulphonamino, (substd.) alkylamino, (substd.) alkylsulphon or (substd.) alkenyl gp.], Rl with R4, R2 with R6 and R1 with R2 may form a ring through a connecting gp.; R7 = H, halogen atom, hydroxy, carboxyl, sulphon, sulphonamido, amino, (substd.) alkyl, (substd.) alkoxy, (substd.) aryl, (substd.) acyl, (substd.) alkylcarboxyl, (substd.) aralkyl, (substd.) alkylcarbonylamino, (substd.) alkylsulphonamino, (substd.) alkylamino, (substd.) alkylsulphon, (substd.) alkenyl, cyano, nitro, mercapto, thiocyano, chlorosulphon, (substd.) alkylthio, (substd.) alkylazomethine or (substd.) alkylaminosulphon gp.; X = S atom or N-R8 (R8 = H atom, (substd.) alkyl, (substd.) aryl, (substd.) aralkyl, (substd.) alkenyl gp.)Y = N atom or C-R9 (R9 has the same meaning as R7). When X = S atom, then Y = N atom, when X = N-R8 then Y = C-R9. USE - The medium is suitable as the disk for recording and reproduction, utilising laser beam. ADVANTAGE - The medium can be recorded and reproduced utilizing laser beam of wavelengths 520 - 690nm, to give higher density recording than those utilizing longer (e.g. 770 - 830nm) wave length beam. 4 more claims. Dwg.0/2 Title Terms: OPTICAL; RECORD; MEDIUM; COMPRISE; SUBSTRATE; BEARING; RECORD; LAYER; REFLECT; LAYER; RECORD; LAYER; CONTAIN; AZO; COMPOUND

Title Terms: OPTICAL; RECORD; MEDIUM; COMPRISE; SUBSTRATE; BEARING; RECORD LAYER; REFLECT; LAYER; RECORD; LAYER; CONTAIN; AZO; COMPOUND Derwent Class: E21; G05; L03; P75; T03; W04
International Patent Class (Main): B41M-005/26
International Patent Class (Additional): C09B-029/08; G11B-007/24
File Segment: CPI; EPI; EngPI

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平10-58828

(43)公開日 平成10年(1998) 3月3日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B41M	5/26			B41M 5/26	Y
C 0 9 B	29/08			C 0 9 B 29/08	A
G11B	7/24	5 1 6	8721 -5D	G11B 7/24	5 1 6

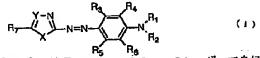
#### 無杏請求 未請求 請求項の数5 OL (全 31 頁)

		審査請求	未請求 請求項の数5 OL (全 31 貝)
(21)出願番号	<b>特願平8</b> -216181	(71)出願人	000003126 三井東圧化学株式会社
(22)出願日	平成8年(1996)8月16日	(72)発明者	東京都千代田区麓が関三丁目2番5号 梅原 英樹 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井
		(72)発明者	東圧化学株式会社内 谷口 義輝 神奈川県横浜市榮区笠間町1190番地 三井
		(72)発明者	東圧化学株式会社内 三沢 伝美 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井 東圧化学株式会社内
		}	最終頁に続く

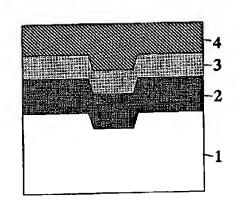
# (54) 【発明の名称】 光記録媒体

## (57)【要約】

【解決手段】 基板上に少なくとも記録層および反射層を有する光記録媒体において、該記録層中に波長450~630nmに吸収極大を有する下記式(1)で示されるアゾ化合物またはその金属錯体を含有し、且つ、波長520~690nmの範囲から選択されるレーザー光に対して記録及び再生が可能であることを特徴とする光記録媒体。



【効果】 波長520~690nmのレーザーで良好な 高密度記録記録及び再生が可能な追記型光記録媒体を提 供することができる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に少なくとも記録層および反射層を有する光記録媒体において、該記録層中に波長450~630nmに吸収極大を有する下記式(1) [化1]で示されるアゾ化合物またはその金属錯体を含有し、且

つ、波長520~690nmの範囲から選択されるレーザー光に対して記録及び再生が可能であることを特徴とする光記録媒体。

【化1】

[式中、R<sub>1</sub>及びR<sub>2</sub>は各々独立に水素原子、置換また は未置換のアルキル基、置換または未置換のアリール 基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置 換のアルケニル基を表し、R<sub>a</sub>、R<sub>a</sub>、R<sub>b</sub>及びR<sub>b</sub>は 各々独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、カ ルポキシル基、スルホン基、スルホンアミド基、アミノ 基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換 のアシル基、置換または未置換のアルキルカルボキシル 基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置 換のアルキルカルボニルアミノ基、置換または未置換の アルキルスルホンアミノ基、置換または未置換のアルキ ルアミノ基、置換または未置換のアルキルスルホン基、 置換または未置換のアルケニル基を表し(ここで、金属 錯体を形成する場合は、R3及びR5のどちらか一方は ヒドロキシ基、カルボキシル基、アミノ基、置換または 未置換のアルキルカルボキシル基、置換または未置換の アルキルカルボニルアミノ基、置換または未置換のアル キルスルホンアミノ基、置換または未置換のアルキルア ミノ基であり、他方は水素原子、ハロゲン原子、ヒドロ キシ基、カルボキシル基、スルホンアミド基、アミノ 基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換 のアシル基、置換または未置換のアルキルカルポキシル 基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置 換のアルキルカルポニルアミノ基、置換または未置換の アルキルスルホンアミノ基、置換または未置換のアルキ ルアミノ基、置換または未置換のアルキルスルホン基、 置換または未置換のアルケニル基を表す。)、 $R_1$  とR4 、R<sub>2</sub> とR<sub>6</sub> 及びR<sub>1</sub>とR<sub>2</sub> は連結基を介して環を形 成してもよく、R<sub>7</sub> は水素原子、ハロゲン原子、ヒドロ キシ基、カルポキシル基、スルホン基、スルホンアミド 基、アミノ基、置換または未置換のアルキル基、置換ま たは未置換のアルコキシ基、置換または未置換のアリー ル基、置換または未置換のアシル基、置換または未置換 のアルキルカルボキシル基、置換または未置換のアラル キル基、置換または未置換のアルキルカルボニルアミノ 基、置換または未置換のアルキルスルホンアミノ基、置 換または未置換のアルキルアミノ基、置換または未置換 のアルキルスルホン基、置換または未置換のアルケニル 基、シアノ基、ニトロ基、メルカプト基、チオシアノ 基、クロロスルホン基、置換または未置換のアルキルチ オ基、置換または未置換のアルキルアゾメチン基、置換

または未置換のアルキルアミノスルホン基を表し、Xは、硫黄原子または $N-R_8$ を表し(ここで、 $R_8$ は水素原子、置換または未置換のアルキル基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置換のアルケニル基を表す。)、Yは、窒素原子または $C-R_9$ を表す(ここで、 $R_9$ は $R_7$ と同じ意味を表す。)。但し、Xが硫黄原子の時、Yは窒素原子であり、Xが $N-R_8$ の時、Yは、 $C-R_9$ である。]

【請求項2】 記録層中に含有する波長450~630 nmに吸収極大を有する化合物が、下記式(2) [化2]で示されるアゾ化合物の金属錯体であることを特徴とする請求項1記載の光記録媒体。

【化2】

[式中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_4$ 、 $R_5$  及び $R_6$  は、式(1)と同じ意味を表し、 $R_8$ は、ヒドロキシ基またはカルボキシル基を表し、 $R_8$  は、水素原子またはハロゲン原子を表す。]

【請求項3】 レーザー波長において、記録層の屈折率が1.8以上、且つ、消衰係数が0.04~0.40であることを特徴とする請求項1または2記載の光記録媒体。

【請求項4】 波長520~690nmの範囲から選択されるレーザー光に対して、基板側から測定した反射率が20%以上であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の光記録媒体。

【請求項5】 基板に案内溝がスパイラル状にあり、この溝ピッチが0.5~1.2 μmであることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の光記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光記録媒体、特に 有機色素を含有する追記型光記録媒体において、従来に 比較して高密度に記録及び再生可能な光記録媒体に関す る。

#### [0002]

【従来の技術】コンパクトディスク(以下、CDと略

す) 規格に対応した追記型光記録媒体としてCD-R (CD-Recordable) が提案・開発されてい る [例えば、日経エレクトロニクス No. 465, P. 107, 1989年1月23日号、OPTICAL DATA S TORAGE DIGEST SERIES vol. 1 P45, 1989等]。このCD -Rは〔図1〕に示すように透明樹脂基板1上に記録層 2、反射層3、保護層4がこの順で積層されており、該 記録層に高パワーのレーザー光を照射することにより、 記録層が物理的あるいは化学的変化を起こし、ピットの 形で情報を記録する。形成されたピット部位に低パワー のレーザー光を照射し、反射率の変化を検出することに よりピットの情報を再生することができる。このような 光記録媒体の記録・再生には一般に波長770~830 nmの近赤外半導体レーザーを用いており、レッドブッ クやオレンジブック等のCDの規格に準拠しているた め、CDプレーヤーやCD-ROMプレーヤーと互換性 を有するという特徴を有する。

【0003】しかしながら、上記の従来の媒体の記録容量は650MB程度であり、動画の記録を考慮すると容量が十分でなく、情報量の飛躍的増加に伴い情報記録媒体に対する高密度化・大容量化の要求は高まっている。

【0004】また、光ディスクシステムに利用される短 波長半導体レーザーの開発が進み、波長680nm、6 50nm及び635nmの赤色半導体レーザーが実用化 されている [例えば、日経エレクトロニクス、No. 5 92、P. 65、1993年10月11日号]。記録· 再生用レーザーの短波長化および対物レンズの閉口数を 大きくすることによりピームスポットを小さくすること ができ、髙密度な光記録媒体が可能になる。実際に半導 体レーザーの短波長化、対物レンズの開口数大化、デー 夕圧縮技術などにより動画を長時間記録できる大容量の 光記録媒体が開発されてきている[例えば、日経エレク トロニクス、No. 589、P. 55、1993年8月 30日号、No. 594、P. 169、1993年11 月8日号]。最近では、2時間以上の動画をデジタル記 録したデジタルビデオディスク(DVD)が開発されて きた。DVDディスクは4.7GBの記録容量を有する 再生専用の媒体であり、この容量に合った記録可能な光 ディスクの開発がさらに要望されている。

【0005】また、YAGレーザーの高調波変換による532nmのレーザーも実用可されている。

【0006】532nmよりさらに短波長の490nmの青/緑色半導体レーザーも研究されているが、まだ実用化の段階まで至っていない[例えば、Applied Physics Letter, P. 1272-1274, Vol. 59 (1991) や日経エレクトロニクスNo. 552, P. 90, 1992年4月27日号]。

【0007】さて、短波長レーザーを使用した場合、光 ディスクの線記録密度と半径方向記録密度は理論的には 同等に高密度化できるが、現状では、半径方向の記録密度は線記録密度ほど大きくすることは困難である。レーザー光は溝またはランドにより回折散乱されるため、トラックピッチを狭くするほど信号検出光量が低下する。また、十分なトラッキング信号が得られる深さを保ったままトラックピッチを狭くするにも成形上限界がある。また溝が深く狭いと、記録層を均一に成膜することが困難である。さらに、溝とランドのエッジ部分は平滑ではなく微小凹凸があるため、ノイズの原因となる。このような悪影響はある程度トラックピッチが狭くなったところで急激に生じる。これらのことを考慮すると、波長520nmで対物レンズの開口数が0.6では溝ピッチの限界は約0.5μmと考えられる。

【0008】追記型光記録媒体の色素層にレーザー光を 照射し、物理変化または化学変化を生じさせることでビ ットを形成させる際、色素の光学定数、分解挙動が良好 なピットができるか否かの重要な要素となる。分解しず らいものは感度が低下し、分解が激しいか、または、変 化しやすいものは、ピット間および半径方向のランド部 への影響が大きくなり、信頼性のあるピット形成が困難 になる。従来のCD-R媒体において、高密度で用いら れているレーザー波長では色素層の屈折率も低く、消衰 係数も適度な値ではないため、反射率が低く変調度が取 れなかった。さらには、絞られたビームで小さいピット を開けるべきところが、周りへの影響が大きく分布の大 きいピットになったり、半径方向へのクロストークが悪 化した。逆にピットが極端に小さくなり変調度が取れな い場合もあった。従って、記録層に用いる色素の光学的 性質、分解挙動の適切なものを選択する必要がある。

【0009】例えば、特開平6-199045号公報は、波長680nmの半導体レーザーで記録再生可能な光記録媒体が提案されている。この媒体は、記録層にシアニン色素を用いており高密度の記録再生の可能性は示しているものの、実際に高密度に記録した記述はない。また、特公平5-67438号公報では、アゾ化合物の金属錯体を用いた光記録媒体を提案しているが、短波長のレーザーでの高密度記録及び本発明の構造のヘテロ環を有するアゾ色素についての記述はない。

## [0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、従来の 光記録媒体では記録層に用いている有機色素が、波長5 20~690nmで吸収が大きく屈折率が小さいまたは 分解挙動が適切でないため、波長520~690nmの 短波長レーザーでの記録及び再生が困難であることを見 出した。そこで本発明の目的は、波長520~690n mの範囲で良好な記録及び再生が可能な高密度記録に適 した光記録媒体を提供することにある。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、本発明を提案する に至った。すなわち、この問題は以下の発明によって解 決される。

【0012】本発明に従えば、記録層に使用する色素を上記のような構造で吸収極大波長が450nm~630nmであるものとすることより、波長520~690nmのレーザー光に対して良好な高密度記録及び再生が可能な光記録媒体が実現される。

【0013】すなわち、本発明は、

① 基板上に少なくとも記録層および反射層を有する光

記録媒体において、該記録層中に波長450~630nmに吸収極大を有する下記式(1) 〔化3〕で示されるアゾ化合物またはその金属錯体を含有し、且つ、波長520~690nmの範囲から選択されるレーザー光に対して記録及び再生が可能であることを特徴とする光記録媒体、

【0014】 【化3】

[式中、R<sub>1</sub> 及びR<sub>2</sub> は各々独立に水素原子、置換また は未置換のアルキル基、置換または未置換のアリール 基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置 換のアルケニル基を表し、R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>、R<sub>5</sub>及びR<sub>6</sub>は 各々独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、カ ルポキシル基、スルホン基、スルホンアミド基、アミノ 基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換 のアシル基、置換または未置換のアルキルカルボキシル 基、置換または未置換のアラルキル基、置換または未置 換のアルキルカルボニルアミノ基、置換または未置換の アルキルスルホンアミノ基、置換または未置換のアルキ ルアミノ基、置換または未置換のアルキルスルホン基、 置換または未置換のアルケニル基を表し(ここで、金属 錯体を形成する場合は、R3及びR5のどちらか一方はヒ ドロキシ基、カルボキシル基、アミノ基、置換または未 置換のアルキルカルボキシル基、置換または未置換のア ルキルカルポニルアミノ基、置換または未置換のアルキ ルスルホンアミノ基、置換または未置換のアルキルアミ ノ基であり、他方は水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキ シ基、カルボキシル基、スルホンアミド基、アミノ基、 置換または未置換のアリール基、置換または未置換のア シル基、置換または未置換のアルキルカルボキシル基、 置換または未置換のアラルキル基、置換または未置換の アルキルカルポニルアミノ基、置換または未置換のアル キルスルホンアミノ基、置換または未置換のアルキルア ミノ基、置換または未置換のアルキルスルホン基、置換 または未置換のアルケニル基を表す。)、R<sub>1</sub>とR<sub>4</sub>、  $R_2$  と $R_6$  及び $R_1$  と $R_2$  は連結基を介して環を形成し てもよく、R<sub>7</sub> は水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ 基、カルポキシル基、スルホン基、スルホンアミド基、 アミノ基、置換または未置換のアルキル基、置換または 未置換のアルコキシ基、置換または未置換のアリール 基、置換または未置換のアシル基、置換または未置換の アルキルカルボキシル基、置換または未置換のアラルキ ル基、置換または未置換のアルキルカルボニルアミノ 基、置換または未置換のアルキルスルホンアミノ基、置

換または未置換のアルキルアミノ基、置換または未置換

のアルキルスルホン基、置換または未置換のアルケニル基、シアノ基、ニトロ基、メルカプト基、チオシアノ基、クロロスルホン基、置換または未置換のアルキルチオ基、置換または未置換のアルキルアシメチン基、置換または未置換のアルキルアシスルホン基を表し、Xは、硫黄原子またはNーR。を表し(ここで、R。は水素原子、置換または未置換のアルキル基、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアルケニル基を表す。)、Yは、窒素原子またはCーR。を表す(ここで、R。はR、と同じ意味を表す。)。但し、Xが硫黄原子の時、Yは窒素原子であり、XがNーR。の時、Yは、CーR。である、1

② 記録層中に含有する波長450~630nmに吸収極大を有する化合物が、下配式(2) [化4]で示されるアゾ化合物の金属錯体であることを特徴とする①記載の光記録媒体、

【0015】 【化4】

$$R_{9} \xrightarrow{N-N}_{N=N} R_{9} \xrightarrow{R_{4}}_{N-R_{2}} R_{1}$$

$$(2)$$

[式中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_4$ 、 $R_5$  及び $R_6$  は、式(1) と同じ意味を表し、 $R_6$ は、ヒドロキシ基またはカルボ キシル基を表し、 $R_9$  は、水素原子またはハロゲン原子 を表す。]

- ③ レーザー波長において、記録層の屈折率が1.8以上、且つ、消衰係数が0.04~0.40であることを 特徴とする①または②記載の光記録媒体、
- ④ 波長520~690nmの範囲から選択されるレーザー光に対して、基板側から測定した反射率が20%以上であることを特徴とする①~③のいずれかに記載の光記録媒体、

#### [0016]

【発明の実施の形態】本発明の具体的な実施の形態につ いて以下に説明する。本発明において光記録媒体とは、 予め情報を記録されている再生専用の光再生専用媒体及 び情報を記録して再生することのできる光記録媒体の両 方を示すものである。但し、ここでは適例として後者の 情報を記録して再生のできる光記録媒体、特に基板上に 記録層、反射層を有する光記録媒体に関して説明する。 この光記録媒体は〔図1〕に示すような基板、記録層、 反射層及び保護層が順次積層している4層構造を有して いるか、〔図2〕に示すような貼り合わせ構造を有して いる。すなわち、基板1'上に記録層2'が形成されて おり、その上に密着して反射層3°が設けられており、 さらにその上に接着層4'を介して基板5'が貼り合わ されている。ただし、記録層2'の下または上に別の層 があってもよく、反射層の上に別の層があってもかまわ ない。

【0017】本発明において基板の材質としては、基本的には配録光及び再生光の液長で透明であればよい。例えば、ポリカーボネート樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリメタクリル酸メチル等のアクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、エポキシ樹脂等の高分子材料やガラス等の無機材料が利用される。これらの基板材料は射出成形法等により円盤状に基板に成形される。必要に応じて、基板表面に案内溝やピットを形成することもある。このような案内溝やピットは、基板の成形時に付与することが好ましいが、基板の上に紫外線硬化樹脂層を用いて付与することが好ましい。重径80ないし120mm程度の円盤状であり、中央に直径15mm程度の穴が開いている。案内溝がスパイラル状の場合、この溝ビッチが0.5~1.2μm程度であることが好ましい。

【0018】本発明においては、基板上に記録層(色素層)を設けるが、本発明の色素層は、1max が450~630nm付近に存在する式(1)で示されるアゾ化合物またはその金属錯体を含有するものである。中でも、520nm~690nmから選択される記録及び再生レーザー波長に対して適度な光学定数を有することが好ましい。

【0019】光学定数は複素屈折率(n+ki)で表現される。式中のn, kは、実数部nと虚数部kに相当する係数である。ここでは、nを屈折率、kを消衰係数とする。

【0020】一般に有機色素は、波長えに対し、屈折率 n と消衰係数 k が大きく変化する特徴がある。この特徴 を考慮して、目的とするレーザー波長において好ましい 光学定数を有する有機色素を選択し記録層を成膜することで、高い反射率を有し、且つ、感度の良い媒体とすることができる。

【0021】本発明によれば、記録層に必要な光学定数

は、前記レーザー光の波長において、nが1.8以上、且つ、kが0.04 $\sim$ 0.40であり、好ましくは、nが2.0以上で、且つ、kが0.04 $\sim$ 0.20である。nが1.8未満の小さい値になると正確な信号読み取りに必要な反射率と信号変調度は得られず、kが0.40を越えても反射率が低下して良好な再生信号が得られないだけでなく、再生光により信号が変化しやすくなり実用に適さない。

【0022】本発明で用いる色素は、式(1)で示されるアゾ化合物またはその金属錯体であり、式(1)の置換基において、ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素であり、好ましくは、フッ素、塩素、臭素である。

【0023】置換または未置換のアルキル基としては、 直鎖または分岐のアルキル基、アルコキシアルキル基、 アルコキシアルコキシアルキル基、アルコキシアルコキシアルコキシアルコキシアルキル基、アルコキシカルボニルアルキ ル基、アルコキシカルボニルオキシアルキル基、ヒドロキシアルコキシカルボニルオキシアルキル基、ヒドロキシアルコキシアルキル基、ヒドロキシアルキル基、シアノアルキル基、アシルオキシアルコキシアルキル基、アシルオキシアルコキシアルコキシアルキル基、アシルオキシアルコキシアルコキシアルキル基、アシルオニルアシアルキル基、アルキルスルホンアミノアルキル基、スルホンアミドアルキル基、アルキルアミノアルキル基、スルホンアミドアルキル基、アルキルアミノアルキル基、アミノアルキル基、及びアルキルスルホンアルキル基の中から選択される。

【0024】ここで直鎖または分岐のアルキル基として は炭素数1~15の炭化水素基で、ポリカーボネート、 アクリル、エポキシ、ポリオレフィン基板等への塗布に よる加工性を考慮すれば、メチル基、エチル基、n-プロ ピル基、iso-プロピル基、n-プチル基、sec-プチル基、 t-プチル基、n-ペンチル基、iso-ペンチル基、2-メチル プチル基、1-メチルプチル基、neo-ペンチル基、1,2-ジ メチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル基、cyclo-ペ ンチル基、n-ヘキシル基、4-メチルペンチル基、3-メチ ルペンチル基、2-メチルペンチル基、1-メチルペンチル 基、3,3-ジメチルプチル基、2,3-ジメチルプチル基、1, 3-ジメチルプチル基、2,2-ジメチルプチル基、1,2-ジメ チルプチル基、1,1-ジメチルプチル基、3-エチルプチル 基、2-エチルプチル基、1-エチルプチル基、1,2,2-トリ メチルプチル基、1,1,2-トリメチルプチル基、1-エチル -2- メチルプロピル基、cyclo-ヘキシル基、n-ヘプチル 基、2-メチルヘキシル基、3-メチルヘキシル基、4-メチ ルヘキシル基、5-メチルヘキシル基、2,4-ジメチルペン チル基、n-オクチル基、2-エチルヘキシル基、2,5-ジメ チルヘキシル基、2,5,5-トリメチルペンチル基、2,4-ジ メチルヘキシル基、2,2,4~トリメチルペンチル基、n-ノ ニル基、n-デシル基、4-エチルオクチル基、4-エチル-

4,5- メチルヘキシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、1,3,5,7-テトラエチルオクチル基、4-プチルオクチル基、6-ジエチルオクチル基、n-トリデシル基、6-メチル-4- ブチルオクチル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、3,5-ジメチルヘプチル基、2,6-ジメチルヘプチル基、2,4-ジメチルヘプチル基、2,2,5,5-テトラメチルヘキシル基、1-cyclo-ペンチル-2,2- ジメチルプロピル基、1-cyclo-ヘキシル-2,2- ジメチルプロピル基等が挙げられる。

【0025】また、アルコキシアルキル基としては、メトキシメチル基、エトキシメチル基、プロポキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、プロポキシエチル基、1、3-シメチルブトキシエチル基、2-エチルへキシルオキシエチル基、1、3-ジメチルブトキシエチル基、2-エチルへキシルオキシエチル基、3、5、5-トリメチルへキシルオキシエチル基、3-メチル-1-iso-プロピルプロポキシエチル基、3-メチル-1-iso-プロピルブチルオキシエチル基、3-スチルー1-iso-プロピルブチルオキシエチル基、3-ストリフルオロプロポキシエチル基、3-メトキシブチル基、3,3、3-トリフロプロポキシエチル基などの炭素数2~15のものが挙げられる。

【0026】アルコキシアルコキシアルキル基の例としては、メトキシエトキシエチル基、エトキシエトキシエチル基、プトキシエトキシエトキシエチル基、1,2-ジメチルプロポキシエトキシエチル基、3-メチル-1-iso-ブチルブトキシエトキシエチル基、2-メトキシ-1-メチルエトキシエチル基、2-(2'-エトキシ-1'-メチルエトキシエチル基、3,3,3-トリフルオロプロポキシエトキシエチル基などが挙げられる。

【0027】アルコキシアルコキシアルコキシアルキル 基の例としては、メトキシエトキシエトキシエチル基、 エトキシエトキシエトキシエチル基、プトキシエトキシ エトキシエチル基、2,2,2-トリフルオロエトキシエトキ シエトキシエチル基、2,2,2-トリクロロエトキシエトキ シエトキシエチル基などが挙げられる。

【0028】アルコキシカルボニルアルキル基の例としては、メトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、メトキシカルボニルスチル基、メトキシカルボニルエチル基、プトキシカルボニルエチル基、プトキシカルボニルエチル基、2,2,3,3-テトラフルオロプロポキシカルボニルメチル基、2,2,3,3-テトラクロロプロポキシカルボニルメチル基等が挙げられる。

【0029】アルコキシカルボニルオキシアルキル基の 例としては、メトキシカルボニルオキシエチル基、エト キシカルボニルオキシエチル基、プトキシカルボニルオ キシエチル基、2,2,2-トリフルオロエトキシカルボニル オキシエチル基、2,2,2-トリクロロエトキシカルボニルオキシエル基などが挙げられる。

【0030】アルコキシアルコキシカルボニルオキシアルキル基の例としては、メトキシエトキシカルボニルオキシエチル基、エトキシエトキシカルボニルオキシエチル基、ブトキシエトキシカルボニルオキシエチル基、2,2-トリフルオロエトキシエトキシカルボニルオキシエチル基、2,2,2-トリクロロエトキシエトキシカルボニルオキシエチル基などが挙げられる。

【0031】ヒドロキシアルキル基の例としては、2-ヒドロキシエチル基、4-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシ-3- メトキシプロピル基、2-ヒドロキシ-3- クロロプロピル基、2-ヒドロキシ-3- エトキシプロピル基、3-ブトキシ-2- ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシー3- フェノキシブロピル基、2-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシブチル基などが挙げられる。

【0032】ヒドロキシアルコキシアルキル基の例としては、ヒドロキシエトキシエチル基、2-(2'-ヒドロキー1'-メチルエトキシ) -1- メチルエチル基、2-(3'-フルオロ-2'-ヒドロキシブロポキシ) エチル基などが挙げられ、ヒドロキシアルコキシアルコキシアルキル基の例としては、ヒドロキシエトキシエトキシエチル基、[2'-(2'-ヒドロキ-1'-メチルエトキシ) -1'-メチルエトキシ] エトキシエチル基、[2'-(2'-フルオロ-1'-ヒドロキシエトキシ) -1'-メチルエトキシ] エトキシー1'-メチルエトキシ] エトキシン・1'-メチルエトキシ] エトキシン・1'-メチルエトキシ] エトキシエチル基、[2'-(2'-クロロ-1'-ヒドロキシエトキシ) -1'-メチルエトキシ] エトキシエチル基などが挙げられる。

【0033】シアノアルキル基の例としては、2-シアノエチル基、4-シアノブチル基、2-シアノ-3-メトキシブロピル基、2-シアノ-3-クロロプロピル基、2-シアノ-3-エトキシプロピル基、3-プトキシ-2-シアノプロピル基、2-シアノプロピル基、2-シアノプロピル基、2-シアノプロピル基、2-シアノブロピル基、2-シアノブチル基などが挙げられる。

【0034】アシルオキシアルキル基の例としては、ア セトキシエチル基、プロピオニルオキシエチル基、プチ リルオキシエチル基、パレリルオキシエチル基、1-エチ ルペンチルカルボニルオキシエチル基、2,4,4-トリメチ ルペンチルカルボニルオキシエチル基、3-フロオロプチ リルオキシエル基、3-クロロブチリルオキシエチル基な どが挙げられ、アシルオキシアルコキシアルキル基の例 としては、アセトキシエトキシエチル基、プロピオニル オキシエトキシエチル基、パレリルオキシエトキシエチ ル基、1-エチルペンチルカルボニルオキシエトキシエチ ル基、2,4,4-トリメチルペンチルカルボニルオキシエト キシエチル基、2-フルオロプロピオニルオキシエトキシ エチル基、2-クロロプロピオニルオキシエトキシエチル 基などが挙げられ、アシルオキシアルコキシアルコキシ アルキル基の例としては、アセトキシエトキシエトキシ エチル基、プロピオニルオキシエトキシエトキシエチル 基、バレリルオキシエトキシエトキシエチル基、1-エチルペンチルカルボニルオキシエトキシエトキシエチル 基、2,4,4-トリメチルペンチルカルボニルオキシエトキ シエトキシエチル基、2-フルオロプロピオニルオキシエ トキシエトキシエチル基、2-クロロプロピオニルオキシ エトキシエトキシエチル基などが挙げられる。

【0035】ハロゲン化アルキル基の例としては、クロルメチル基、クロルエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、トリフルオロメチル基、プロムメチル基、ヨウ化メチル基などが挙げられる。スルホンアルキル基の例としては、スルホンメチル基、スルホンプロビル基などが挙げられる。

【0036】アルキルカルボニルアミノアルキル基の例としては、メチルカルボニルアミノエチル基、エチルカルボニルアミノエチル基、プロピルカルボニルアミノエチル基、シクロヘキシルカルボニルアミノエチル基、スクシンイミノエチル基などが挙げられる。

【0037】アルキルスルホンアミノアルキル基の例としては、メチルスルホンアミノエチル基、エチルスルホンアミノエチル基、プロピルスルホンアミノエチル基などが挙げられる。スルホンアミドアルキル基の例としては、スルホンアミドメチル基、スルホンアミドエチル基、スルホンアミドプロピル基などが挙げられる。

【0038】アルキルアミノアルキル基の例としては、 N-メチルアミノメチル基、N,N-ジメチルアミノメチル 基、N,N-ジエチルアミノメチル基、N,N-ジプロピルアミ ノメチル基、N,N-ジブルアミノメチル基、などが挙げら れる。アミノアルキル基の例としては、アミノメチル 基、アミノエチル基、アミノプロピル基などが挙げられる。

【0039】アルキルスルホンアルキル基の例としては、メチルスルホンメチル基、エチルスルホンメチル基、ブチルスルホンエチル基、メチルスルホンエチル基、エチルスルホンエチル基、2,2,3,3-テトラフルオロプロピルスルホンメチル基などが挙げられる。

【0040】置換または未置換のアルコキシ基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルコキシ基であり、好ましくは、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、iso-プロポキシ基、n-プトキシ基、iso-プトキシ基、t-プトキシ基、n-ペントキシ基、iso-ペントキシ基、neo-ペントキシ基、2-メチルブトキシ基などの低級アルコキシ基が挙げられる。

【0041】 置換または未置換のアリール基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアリール基であり、好ましくは、フェニル基、ニトロフェニル基、シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メチルフェニル基、トリフルオロメチルフェニル基、ナフ

チル基、ニトロナフチル基、シアノナフチル基、ヒドロキシナフチル基、メチルナフチル基、トリフルオロメチルナフチル基などが挙げられる。

【0042】置換または未置換のアシル基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアシル基であり、好ましくは、ホルミル基、メチルカルボニル基、エチルカルボニル基、n-プロビルカルボニル基、iso-プロピルカルボニル基、sec-ブチルカルボニル基、t-プチルカルボニル基、n-ペンチルカルボニル基、iso-ペンチルカルボニル基、1so-ペンチルカルボニル基、1so-ペンチルカルボニル基、1so-ペンチルカルボニルストルカルボニルステルカルボニルステルガチルカルボニルステルカルボニルステルカルボニルステルガチルカルボニルステルカルボニルストロベンジルカルボニルスをとが挙げられる。

【0043】置換または未置換のアルキルカルボキシル基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルキルカルボキシル基であり、好ましくは、メチルカルボキシル基、iso-プロビルカルボキシル基、n-プェビルカルボキシル基、iso-プチルカルボキシル基、sec-プチルカルボキシル基、t-プチルカルボキシル基、n-ペンチルカルボキシル基、iso-ペンチルカルボキシル基、neo-ペンチルカルボキシル基、2-メチルプチルカルボキシル基などの低級アルキルカルボキシル基が挙げられる。

【0044】置換または未置換のアラルキル基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアラルキル基であり、好ましくは、ベンジル基、ニトロベンジル基、シアノベンジル基、ヒドロキシベンジル基、メチルベンジル基、トリフルオロメチルベンジル基、ナフチルメチル基、ニトロナフチルメチル基、シアノナフチルメチル基、ヒドロキシナフチルメチル基、メチルナフチルメチル基、トリフルオロメチルナフチルメチル基をどが挙げられる。

【0045】 置換または未置換のアルキルカルボニルアミノ基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルキルカルボニルアミノ基であり、好ましくは、メチルカルボニルアミノ基、エチルカルボニルアミノ基、n-プロピルカルボニルアミノ基、iso-プロピルカルボニルアミノ基、n-プチルカルボニルアミノ基、iso-プチルカルボニルアミノ基、sec-ブチルカルボニルアミノ基、neo-ペンチルカルボニルアミノ基、100-ペンチルカルボニルアミノ基、シクロヘキシルカルボニルアミノ基、スクシンイミノ基などの低級アルキルカルボニルアミノまが挙げられる。

【0046】 置換または未置換のアルキルスルホンアミノ基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルキルスルホンアミノ基であり、好ましくは、メチルスルホンアミノ

基、n-プロピルスルホンアミノ基、iso-プロピルスルホ ンアミノ基、n-プチルスルホンアミノ基、iso-プチルス ルホンアミノ基、sec-プチルスルホンアミノ基、t-プチ ルスルホンアミノ基、n-ペンチルスルホンアミノ基、is o-ペンチルスルホンアミノ基、neo-ペンチルスルホンア ミノ基、2-メチルプチルスルホンアミノ基、シクロヘキ シルスルホンアミノ基などの低級アルキルスルホンアミ ノ基が挙げられる。

【0047】置換または未置換のアルキルアミノ基の例 としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有 するアルキルアミノ基であり、好ましくは、N-メチルア ミノ基、N.N-ジメチルアミノ基、N.N-ジエチルアミノ 基、N,N-ジプロピルアミノ基、N,N-ジブチルアミノ基な どの低級アルキルアミノ基が挙げられる。

【0048】置換または未置換のアルキルスルホン基の 例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を 有するアルキルスルホン基であり、好ましくは、メチル スルホン基、エチルスルホン基、n-プロピルスルホン 基、iso-プロピルスルホン基、n-プチルスルホン基、is o-ブチルスルホン基、sec-ブチルスルホン基、t-ブチル スルホン基、n-ペンチルスルホン基、iso-ペンチルスル ホン基、neo-ペンチルスルホン基、2-メチルプチルスル ホン基、2-ヒドロキシエチルスルホン基、2-シアノエチ ルスルホン基などの低級アルキルスルホン基が挙げられ る。

【0049】置換または未置換のアルケニル基の例とし ては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有する アルケニル基であり、好ましくは、プロペニル基、1-ブ テニル基、iso-プテニル基、1-ペンテニル基、2-ペンテ ニル基、2-メチル-1- プテニル基、3-メチル-1- プテニ ル基、2-メチル-2- ブテニル基、2,2-ジシアノビニル 基、2-シアノ-2- メチルカルボキシルビニル基、2-シア ノ-2- メチルスルホンビニル基などの低級アルケニル基 が挙げられる。

【0050】置換または未置換のアルキルチオ基の例と しては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有す るアルキルチオ基であり、好ましくは、メチルチオ基、 エチルチオ基、n-プロピルチオ基、iso-プロピルチオ 基、n-プチルチオ基、iso-プチルチオ基、sec-プチルチ オ基、t-ブチルチオ基、n-ペンチルチオ基、iso-ペンチ ルチオ基、neo-ペンチルチオ基、2-メチルプチルチオ 基、メチルカルボキシルエチルチオ基などの低級アルキ ルチオ基が挙げられる。

【0051】 置換または未置換のアルキルアゾメチン基 の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置換基 を有するアルキルアソメチン基であり、好ましくは、メ チルアゾメチン基、エチルアゾメチン基、n-プロピルア ゾメチン基、iso-プロピルアゾメチン基、n-プチルアゾ メチン基、iso-プチルアゾメチン基、sec-プチルアゾメ チン基、t-プチルアソメチン基、n-ペンチルアゾメチン

基、iso-ペンチルアゾメチン基、neo-ペンチルアゾメチ ン基、2-メチルブチルアソメチン基、ヒドロキシエチル アゾメチン基などの低級アルキルアゾメチン基が挙げら れる。

【0052】置換または未置換のアルキルアミノスルホ ン基の例としては、上記に挙げたアルキル基と同様な置 換基を有するアルキルアミノスルホン基であり、好まし くは、N-メチルアミノスルホン基、N-エチルアミノスル ホン基、N-(n- プロピル) アミノスルホン基、N-(iso-プロピル) アミノスルホン基、N-(n- ブチル) アミノス ルホン基、N-(iso- ブチル) アミノスルホン基、N-(sec - プチル) アミノスルホン基、N-(t- ブチル) アミノス ルホン基、N-(n-ペンチル) アミノスルホン基、N-(iso - ペンチル) アミノスルホン基、N-(neo- ペンチル) ア ミノスルホン基、N-(2- メチルプチル) アミノスルホン 基、N-(2- ヒドロキシエチル) アミノスルホン基、N-(2 - シアノエチル) アミノスルホン基などの低級アルキル アミノスルホン基が挙げられる。

 $[0053]R_1$  と $R_4$  または $R_2$  と $R_6$  が連結基を介 して環を形成した例としては、-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-、-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>- $\ \ -CH_2CH(C1) - \ \ -CH_2C(=0)CH_2 - \ \ \ -CH_2C(=0) - \ \ -CH_2C$ H<sub>2</sub>C(=0)- 、-CH<sub>2</sub>CH(F)-、-CH<sub>2</sub>CH(OH)- 等が挙げられ る。 $R_1$  と $R_2$  が連結基を介して環を形成した例として  $\verb|-it_-CH_2CH_2OCH_2CH_2--CH_2CH_2NHCH_2CH_2--CH_2CH_2N(C)|$  $H_3$ )  $CH_2CH_2$ -,  $-CH_2C$  (=0) OC (=0)  $CH_2$ - ,  $-CH_2C$  (=0) NHC (=0)  $CH_2-$ ,  $-CH_2C(=0)N(CH_3)C(=0)CH_2-$ ,  $-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2-$ 等が挙げられる。

【0054】本発明の式(1)で表される化合物は、公 知の方法により、次の様に製造される。すなわち、式

- (3) 〔化5〕で示されるアミン成分をジアゾ化し、式
- (4) [化5] で示されるカップリング成分の溶液に添 加し、カップリング反応させて式(1)で示されるアゾ 化合物が得られる。

[0055]

【化5】

$$R_{7} = N + NH_{2}$$
 (3)

じ意味を表す。〕

【0056】また、本発明においては、前記アソ化合物 の金属錯体の製造法は公知の方法、例えば、古川; Anal ytica Chimica Acta 140(1982) 281-289に記載の方法等 に準じて製造することができる。アソ化合物の金属錯体 を形成する金属としては、例えば、ニッケル、コバルト、鉄、ルテニウム、オジウム、パラジウム、鋼、オスミウム、イリジウム、白金、亜鉛、マグネシウム、マンガン等の金属が好ましく、特にニッケル、コバルト、鋼、パラジウム、鉄、亜鉛、マンガンが好ましい。これらは製造時に酢酸塩、ハロゲン化物、BF $^{4-}$ 塩等の形で用いられ、Ni $^{2+}$ 、Co $^{2+}$ 、Co $^{3+}$ 、Cu $^{2+}$ 、Pd $^{2+}$ 、Fe $^{2+}$ 、Fe $^{3+}$ 、Zn $^{2+}$ 、Mn $^{2+}$ 等としてアゾ化合物に

配位した錯体として得られる。このアゾ化合物の金属錯体は、単独でも複数の化合物を混合しても良い。

【0057】この式(1)で示されるアゾ化合物及びその金属錯体の具体例としては、表1〔表1〕~〔表7〕及び表2〔表8〕~〔表13〕に示す置換基及び配位金属を有する化合物が挙げられる。

【0058】 【表1】

化合物 1-1	œ	a a	æ	ď	ď	æ	d	>	:	
1-	-				ο.		2	<	>	角題
	Ф₂Ф₂он	H2,42,44	I	oo F	I	I	र्द	N-CH2GH	S	
1-2	ಗಿಯಯ್ಡಿಗೆ ಬ್	ಭಾಯ-ಭಾಯ-ಭ	I	I	I	I	క	Ç-8-4	ş	•
	ಕ್ಷುಭಾಭಾ	<b>ಅ್ಯಾಂಗ್ಯಾಯ್ಕ</b>	I	I	I	I	x	N-CH2GH3	SCH,	
4-1	CH, COOCH, CF, CHF,	CHOOCHICFOHE CHOOCHICFICHE	r	I	I	I	ಕೆ	N-CH <sub>3</sub>	g	
9-1	පිස්	90%D	I	I	₹	I	ಕೆ	N-CH3	Ş	
9-	f f	ch ch	I	I	5	I	ъ	¥ 5	8	•
1-7	<b>.</b>	CHECK NHCOCHS	I	I	퓽	I	రో	Ŧ	S	
8-	ಕ್ರಾಕ್ಷಕ್ಕ	CH2CH2CCCHCH3	r	I	₹	r	I	Ŷ	CCCCCH	•
1-9	ᡱᠣᡮᠣᡮᠣ	ക്കുക്കു	I	ಯ್ಯಂಗ್ರ	₹	I	I	N-CH=CHCH <sub>3</sub>	CCCCCH,	
1-10	မှာမှာ	fo <sub>f</sub> o	I	I	NHCOCH,	I	₹	N-CH2GH2	C	
1-11	<u>೧</u> ೩೦೪೦೪೦೪೦	Charanan	I	I	NHOOOH	I	కో	ī	COOCH2CH	,
1-12	P 8	<b>?</b>	I	I	N <del>TCOC</del>	I	ಕೆ	K CH	COONE	•
1-13		್ತಿ ರಸ್ತಿದಳ್ಳಿಂದಗ್ನಿಂಗ್ರಾ	I	I	NHOOCH	I	I	NCH <sup>3</sup>	CC00H	•
1-14	๛๛๛๛	ᡩᡡᡧᡡ	I	r	NHCOCH	I	రే			
1-15	ජ්	on on on	I	ş	NHOOCH	I	ર્ફ	¥		
1-16	<b>ಆ</b> ಭ್ಯಾಭ್ಯ	ಕ್ಷಾ ಆ್ಯಾಧ್ಯಾಧ್ಯ	I	I	NHCO (H)	I	ર્ફ	ž	C-NO <sub>2</sub>	•
	8. 6. 6. 6. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		क्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्	क्ष्म्त्रक्त         क्ष्म्त्रक्त           क्ष्म्त्रक्त         क्ष्म्प्रक्रक्र           क्ष्म्त्रक्त         क्ष्म्प्रक्रक्त           क्ष्म्त्रक्त         क्ष्म्प्रक्रक्त           क्ष्म्त्रक्त         क्ष्म्प्रक्रक           क्ष्म्प्रक्रक         क्ष्म्प्रक्रक           क्ष्म्प्रक्रक         क्ष्म्प्रक्रक           क्ष्म्प्रक्रक         क्ष्म्प्रक्रक           क्ष्म्प्रक्रक         क्ष्म्प्रक्रक           क्ष्म्प्रक्रक         क्ष्म्प्रक्रक           क्ष्म्प्रक्रक         क्ष्म्प्रक्रक	다음다는 다음다는 H  다음다는 다음다는 다음다는 다음다는 다음다는 다음다는 다음다는 다음다	Ферсов         Советния         Н         Н           Советния         Советния         Н	Ферен         Серення         Н         Н         ОН           Серен         Серен         Н         Н         ОН         ОН	다는다는 다는다는 다는다는	여ትርት         여ትርት         여ትርት         H	다는다는 다는다는 다는다는 H H CH H CH H CN NCH  다는다는다는다는 다른다는다으로 H H H CH H CH NH  다는다는다는다는 다른다는다으로 H H CH CH H CH NH  다는다는다는다는 CH CH-CH-CH-CH H H CH CH NHCOCH H H H CH NHCHH CH CH-CH CH-CH CH-CH CH-CH CH-CH CH-CH CH-CH CH-CH CH-CH CH CH CH CH CH CH CH-CH CH C

[0059]

【表 2 】

「シが)

•				į						
化合物	Ŗ	Re	ď	8	æ	g.	Ъ	×	<b>&gt;</b>	金属
1-17	CHOOOCHEOFE	aqooochegisari aqooochasari	F	I	NHOO H	Ŧ	I	N-CH <sub>2</sub> Gt <sub>2</sub>	o o	
1-18	40404040	<b>ಈರ್ಭರ್ಯ</b>	r	I	NHOO	I	ಕೆ	Ç	8	•
1-19	HO,HOH	ю <del>,</del>	I	8	NHCO	I	కో	NO4CH	Š	
1-20	G1,04,04,04,	ಈ <b>ಭ್</b> ಭಾಗಿ	I	I	N-COCHECHEG	I O	I	S. G. S.	COOOCH3	
1-21	R, と遊茄	R。七連結	I	(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>	ō	(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>	I	N.C.K.	C-NO2	
1-22	A.と連結	R。と連結	r	CH2 COCH2	రే	കുയാകു വ്യവ	<b>,</b>	Ī	Š	
1-23	Roと連結	04,004,004,042	I	r	NHCOCH	r	8	ž	CCCCCH3	
1-24	<u>ರ್ಭಿ</u> ದ್ಯಾರ್ಥ	I	I	I	8	I	ū	Ī	неоэч	
1-25	ಚಿಂಚಾಚಾಚಾ	I	I	I	S H S	I	కో	Ē	CSO <sub>2</sub> NH <sub>2</sub>	
1-26	GN, GN, GN, GN,	0	r	I	SO <sub>2</sub> NH <sub>2</sub>	r	र्ह	ī	C-NH2	
1-27	CHCHCH	ge-chO <sub>t</sub>	I	I	N Y	I	ਲੈੰ	Ē	COCH <sub>8</sub>	
1-28	ರ್ಷೆಯ್ಗೆ ರ <sub>ಗ</sub> ೆ	<b>೧</b> ೩೦೬೦೩೦%	I	I	SOOCH,	I	కో	Ī	Ş	
1-29	G2.42.43.43.	ᢗᢋᡘᢋᢗᢋ	I	r	NHSO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	I	ર્દ	Ī	Q F	•
1-30	GH2GH2GH3	akakakak	I	I	0	r	క	¥	C-NHCOCH <sub>3</sub>	
1-31	<b>ದ್ಯುದ್ಯು</b> ದ್ಯು	CH2CH2CH2	I	I	8	I	I	¥	. CANHSO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	
1-32	ch <sub>e</sub> ch <sub>e</sub> ch <sub>e</sub> ch	<u> </u>	I	I	Q 40	Ι	I	¥	C-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	

【0060】 | <sup>2</sup>|

【0061】 【表4】

化合物	P,	a. L	æ	ď	윤	æ	45	×	>	金属
1-33	chichichichi	೧೪೮೩೮೩೮	Ŧ	I	NH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	I	I	N.CH.	COHO	•
1-34	HO POP	ക്ക്ഷ	I	x	SOL	I	I	N CH3	ਲੂ ਜੁ	•
1-35	ҾѽҾ	HO4D4D	I	I	CHECHCH3	I	I	Ē	S S S S	
1-36	Ффф	GH2GH2OH	<b>#</b>	王	Ŧ	I	동	RCH <sub>2</sub>	030°C	•
1-37	Ѩ҈ѻ҈ѩ	HO4O4D	I	I	I	I	I	¥	C-CH=NCH2CH2OH	₹
1-38	, ффф	₽. ₽.	. =	I	I	I	I	¥	C-SO <sub>2</sub> NHCH <sub>3</sub>	

表1(

1(つが状)

化合物	Æ	윱	æ	귵	ي.	ď.	d <sup>2</sup>	×	>	N 4
1-39	њ <sub>е</sub>	HO2HO4HO	F	8	I	I	ಕೆ	s	-	H .
1-40	CHECHECOOCH	CH2 CH2 COOCH3	I	I	I	I	នឹ	S	Z	
1-41	Q42Q42Q43	#0%+0%+0	I	I	I	I	ပ်	w	z	•
1-42	CHS COCH C CHF2	GHCCCCH, CF2 CHF2	I	I	I	I	I	Ø	z	
1-43	£ ₹ 5	CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	I	I	£	I	I	ဟ	z	
1-44	CH2CH2CH2	<u> </u>	I	I	₹	I	I	Ø	z	
1-45	£ £	Che Ch	I	I	₹	I	Ö	Ø	z	
1-46	ф. Ф.	CHECHENHOOCH	I	I	₹	I	ģ	ω	z	
<b>24-</b> 表5]	ಕ್ಷಾರ್ಥಿಕ್ಕರಿಕ್ಕರ ಕ್ಷಾರ್ಥಿಕ್ಕರಿಕ್ಕರ	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CCCCHCH <sub>3</sub>	r	I	£	E	Š Š	Ø	z	
1-48	ಈಂಗ್ರಹಿಗೆ ಆ	<b>ಹಿಂಕೆಂಕೆಂಕೆ</b>	I	904,CH	-	I	3	Ø	z	
1-49	<b>₩</b>	<b>.</b>	I	I	N-COCH.	I	ě	w	Z	
1-50	CH2CH2CCH2CH3	CH2CH2CCH2CH3	I	I	NHOOOH	I	ä	Ø	z	
1-51	P &	Ŷ ŧ	I	x	NHCOCH,	I	ă	Ø	z	
1-52	CH2CH2OCH2CH(CH3)2	೧೪೦೪,೦೦೪,೦೫(೧೫೨)2 ೦೩,೦೫,೦೦%,೦೫(೦೫೨)2	r	r	NHCOCH	I	齿	v)	Z	
1-53	CH2CH2CH2CH8	40404040	r	I	NHCOCH	r	r	Ø	Z	:
1-54	<del>О</del> 2 <del>0</del> 3	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CN	I	<b>8</b>	NHCOOH	I	ക്കു	ß	z	

[0062]

(シンギ)

化合物	Æ	8	æ	ď	P <sub>e</sub>	å	R <sub>7</sub>	×	>	金属
1-55	CH2CH2CH	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH	I	I	AHCO-HN	I	ညီ	S	z	,
1-56	CH2CH2CH3	CHOHOHOHO	I	I	AHCO+H	I	SCH, CH, COOCH,	S	z	
1-57	CH-COCCH-CHE, CH-CHE,	ಯಯಯ್ಯರ್ ೧೯೬೬	r	I	HOOH	I	I	Ø	z	•
1-58	<del>ъ</del>	ජි ජී	I	8	NHCO H	I	I	Ø	z	
1-59	CH2CH2CH2	<b>೧</b> ೩೦೩೦೩	I	I	O-CO-N	I	CH=NCH2CH2OH	Ø	z	
1-60	но но но	CH2CH2OH	I	8	NHCO	I	ă	Ø	z	
1-61	<b>८५.९५.९५</b>	CH2CH2CH2CH3	I	I	NHCOCH, CH, CI	I	x	Ø	z	•
1-62	なる単語	R.と遊档	I	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	ច	(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>	I	Ø	z	•
1-63	Ra七連結	R。七連結	r	ch, coch	र्ह	or sooch	I ·	Ø	z	•
1-64	Roと連結	CH, CH, CH, CH,	I	I	NHCOCH	I	<b>5</b>	(s)	Z	•
1-65	ಭ್ಯಭ್ಯಭ್ಯ	ರ್.ದಿ.ದ್ಯರ್	I	I	₹	I	ã	Ø	2	•
1-66	CH2CH2CH2CH3	CH <sup>2</sup> CH <sup>2</sup> CH <sup>3</sup>	I	I	₹	I	ဗ်	Ø	z	
1-67	CH2CH3	CH2CH3	I	I	₹	I	N(CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>	Ø	z	
1-68	GH2GH2GH	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH	I	I	NHCO-H	r	I	(3)	z	
1-69	£	90% 04°04°	Ι	ğ	NHCOCH	I	I	တ	<b>z</b>	
1-70	c <del>ಸ್</del> ರಧ್ಯಾಧ್ಯ	<del>೧</del> ೪೦೪೦೪೦೪	I	I	НООО	I	I	Ø	z	

[0063]

【表6】

NHSO<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> N(CH<sub>S</sub>)<sub>2</sub> æ NHSO<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> 10000 10000 10000 N(CH<sub>3</sub>)2 30<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> æ æ **ಈ** ದ್ಯಾರ್ಥನ್ನ <u> ೧</u>೪೦೬೦೪೦೪ CLCH, CH GH2GH2GH G₽,G₽,QH S S S S გ გ გ ዯ፟፟ኇ t t GH, CH, CH, CH, CH2CH2CH2CH3 ൮ഄ൷൷൘ ക്കുകുക ೧೪,೦೪,೦೪,೦೪, Ффф CH2CH2OH GE GEOH Æ £9 F ያ ያ g G £0% £0.49 化合物 1-76 1-73 1-75 1-72 1-74 1-78 1-79 1-80 1-82 1-84 1-85 1-86 1-71 1-77 1-81 1-83

【0064】 【表7】

金属

【0065】 【表8】

化合物	æ	P,	Ra Ra	ď	æ	쬬	4	×	>	金属
1-87	ಈಭ	ଫୁଫ୍ଷ	I	Ŧ	NHCO—{H}	I	80,0	S	z	
1-88	ф <b>ъ</b>	ch <sub>2</sub> Ch <sub>3</sub>	Î	I	NHCO-(H)	I	SO <sub>2</sub> NHCH <sub>3</sub>	S	Z	
1-89	<b>.</b>	<b>&amp;</b> &	동	I	I	కో	ă	0	z	
1-90	ch'ch's	ભ <b>્ર</b> ભ	I	I	NHCO-{H}	I	SO <sub>2</sub> NHCH <sub>3</sub>	0	z	•
1.91	ස්ත්	жж.	900 HOO	I	I	I	<b>8</b> 0°C	0	z	
1-92	ଫୃଫ୍ଷ	CH <sub>2</sub> OH <sub>3</sub>	I	I	(H)	I	SO <sub>2</sub> NHCH <sub>3</sub>	0	z	

-15-

化合物	æ	Ł.	Pg	ď	æ	Вв	4	×	>	金属
2-1	40°40°40	ಭ್ಯಾಭ್ಯವಿಕ್ಕು ಆ	8	т	н	r	ซึ	N-CH2OH3	Š	Ξ
2-2	୴୴୷୷୷	ಯ್ ಯಾಗ್ಗೆಯ	NHCOCH	I	I	8	$\mathcal{E}$	<b>\$</b>	ह	ź
2-3	() ř	<b>\</b>	NHOOOH	S H	I	SO <sub>2</sub> H	I	N-CH <sub>2</sub> OH <sub>3</sub>	SOH,	æ
2-4	CHICH2OCHECH(CH3)\$	CH <sup>2</sup> CH <sup>2</sup> COCH <sup>2</sup> OH <sup>2</sup> CH <sup>2</sup> COCH <sup>2</sup> COCH <sup>2</sup> OCH <sup>2</sup> O	NHOOOHs	I	I	I	ಕೆ	NCH <sub>3</sub>	S	Ź
2-5	ਲੇ ਲੇ	సిసి	퓽	I	I	I	ಕೆ	N-CH3	S	Ē
2-8	കുകുകുക	<b>&amp;</b> &&&&	₹	I	I	I	3	N-CH3	5	Z
2.7	೦ಗ್ಮಿ೦ಗ್ನಂH(CH <sub>3</sub> )₂	CH2CH2CH(CH3)2	NHCOCH	ਹ	I	ō	క	¥	So	ភ
2-8	9424249 94245	ಭ್ಯಭ್ಯಭ್ಯ	₹	I	I	I	I		, 100005	ž
o- で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	<u> </u>	<b>ಈಂಭಿಂಭಿ</b>	₹ (	I	I	x	I	N-CH-CHCH <sub>3</sub>	ссоосн	Ż
2-10	Ayaya.	<b>4</b> 0%о	N-TOO-H	I	r	₹	₹	N-CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	NO O	2
2-11	ಆಯ್ ಯಾಗ್ಗೆ ಯ	checheocheon	NHCOCH	I	I	NHCOCH	కో	¥	CCOOCH,	72
2-12	*5**	<b>७५०</b> ५०	₹	r	I	I	క	N CH	C-CONH2	Z
2-13	CHECH, NHSO, CH	CH2CH2NHSO2CH3	₹	I	I	I	I	N-CH	CC00H	ž
2-14	CH2CH2CH3	% <b>0</b> % <b>0</b> %0%	₹	r	I	I	र्द	N S NO2	(L) 000	ž
2-15	<b>ಈ್ತಿಯ್ದಾಯ್ಟ</b>	chohohoh	₹	I	r	I	క	} ₹	Cso.	Ï
2-18	ch <sub>2</sub> ch <sub>6</sub>	G.G.	80 <del>0</del>	I	I	I	ಕ	¥	C-NO <sub>2</sub>	ź

[0066]

(しが巻)

化合物	æ	æ	æ	괍	عے ا	æ	<b>₽</b>	×	>	
2-17	ಚಿಂಡಾ, ಡ್ಯಾಂಡ್ಯ	೧೫೦೦೪೦೪೦೦೪	- B	I	Ŧ	Ŧ	×	N-CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	-   8	N
2-18	CH, CH, NHCOCH,	CH_CH_NHCOCH_	8	8	I	I	క	Ç	ş	Z
2-19	Gr.CH20CH2CH(CH3),1	೦೫೦೩೦೦೪೦೫(೧ೖ),೦೪೮೪೦೩೦೦೪೦೫(೧೪),2	8	3,	I	S H	కో	Not.	8	ž
2-20	දි	දි	NHSO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	I	Ę	I	I	N-CH2-(1) CCCCCH2CH3	40°40000	Z
2-21	ಆ, ಆ, ಆ, ಆ,	<u> ೧</u> ೪೦೪,೦೪,೦೪	₹	I	r	NHSOZGH	x	) 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	C-NO2	Z
2-22	ಈ.ಈ.ಈ.ಈ ಈ	ಈಂಭಿರ <sub>ಕ</sub> ರಿಗ	용	I	I	r	ଫ୍ଲଫ୍ଲ	Ŧ	ξ	Z
2-23	ಭಾನಿಕ್ಕಾಗು	<b>೧</b> ೪೭೪೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩೩	₹	<del>8</del>	I	I	₽ <u>2</u> ₽	Ŧ	CCOCH	Co(3+)
2-24	4500040	ch <sub>2</sub> coch <sub>2</sub> ch <sub>3</sub>	둉	OCH2 CH3	r	I	ō	¥	C-80 <sub>3</sub> H	Co(2+)
2-25	<b>Ф</b> Ф	Ch2Ch2OH	NHCH.	I	r	ş	రో	Z	CSO <sub>2</sub> NH <sub>2</sub>	2
2-26	CH2COCCH2CF2CHF2	GH2000H2G2GHF2	x	COCH CH	I	I	రో	ī	CANT	ភូ
2-27	क्रिक्रें छ	&.Q.20	₽	I	I	<b>्र</b>	రో	¥	, , , ,	Ź
2-28	CH, CH=CH,	CH_CH=CH₂	₽	I	I	P	ಕೆ	¥	Ş	ភ
2-29	£4545	ರ್ಷ <b>್ಟ್ ಧ್ಯ</b> ಧ್ಯ	₹	I	I	రే	ಕೆ	ž	CCH	5
Z-30	7	I	8	I	r	I	ర్	¥	C-NHCOCH <sub>3</sub>	ភ
2-31	<b>ಕ್</b>	ชั้	HO03	I	r	NHSO <sub>3</sub> H	I	¥	C-NHSO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	Co(3+)
2-32	8	ಧ್ಯಭ್ಯ	8	I	r	SOCH	I	¥	C-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	

【0068】 【表11】

化合物	Ŗ	P <sub>2</sub>	æ	ď	ď	æ	Æ	×	>	日
2-33	R2と連結	CH_CH_NHCOCH_1	동	r	F	I	=	r FOF	C-CH=CHCH <sub>6</sub>	
2-34	RAと連絡	Reと連結	8	(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>	r	(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>	I	ť	3	Mn(2+)
2-35	Ruと連絡	Reと連結	5	\$000 HD	I	ф ф ф	I	¥	283	Z
2-36	<b>₹</b>	HO HO HO	푱	I	r	I	푱	N-CH <sub>3</sub>	C.80,C	Z
2-37	ਲ <b>ੱ</b> ਲੈਂਨੈ	£%&	80 H	x	I	I	I	ž	C-CM=NCH2CH3 NI	Z
2-38	ರ್ಣಿಧ್ಯಾಧ್ಯಾಧ್ಯ	क् <sub>र</sub> क्रक्रक	₹	I	I	I	ક	NCH2 H	§	Z
2-39	ර්ර්	หือหือ	₹	I	I	I	8	NOH2Q42Q49	<b>-</b> 59	₹
2-40	ಭಾಗುಭಾಗು	<b>ಈದ್ಯ</b> ದ್ಯಾರ್	5	x	r	I	8	NCH2CH2CH3	S C CON	Cu(2+)

2

化合物	Æ	æ	Я	ď	æ	Pe	H-	×	>	金属
2-41	45454545	ರ್ಣರಕ್ಷರಾ	₽	I	I	I	đ	Ø	z	Ē
2-42	G4,004,0043	CH, CH, CCH, CH,	NHOOCH	I	I	8	ធ្ល	Ø	z	Z
2-43	<b>्र</b>	<b>\rightarrow</b>	NHCOCH	8 7	I	нсоз	£	Ø	z	2
2-44	ರ್ಷಚಾಯಗ್ರಭ	ONECHEOCHECH(CHS)2 CHECHECHS)2	NHCOOH <sub>3</sub>	r	I	I	ă	Ø	z	Z
2-45	Q <sub>2</sub> Q <sub>3</sub>	%04°	₹	I	I	I	I	Ø	z	ž
2-46	<b>കു</b> കുകു	CH2CH2CH3	₹	I	I	I	I	Ø	z	Z
2-47	CH2CH(CH3)2	CH2CH(CH3)2	NHCOCH	ਠ	I	ច	I	Ø	z	5
2 49 49	ಹಿತ್ತುಕ್ಕಾರಿಕ	<b>ದ್ಯುದ್ಯುದ್ಯು</b>	₹	I	I	I	0	ø	z	ž
€1 2 64-	ಈರ್. ರಸ್ತರ್ಭರ್ಭರ್	<b>ಈಯ್</b> ಯ	퓽	I	I	I	ā	v>	z	Z
7-20	CH2CH2CH	HOHOHO	NHCO (H)	I	I	₹	8	Ø	z	2
2-51	CH2CH2OCH2OH	H02H202H2	NHCOCHS	I	I	NHCOCH	I	Ø	z	72
2-52	ଫ୍ଟଫ	, Po <sup>#</sup> O	ቼ	I	r	Ŧ	<del>8</del>	Ø	z	Ë
2-53	CH2CH2NHSO2CH3	CH2 CH2NHSO2CH3	₹	I	I	I	ኇ፟ጜ	Ø	z	Z
2-54	CH2CH2CH3	<del>೧</del> % ೧% ೧% ೧%	5	I	I	I	SCH2CH3	Ø	z	ž
2-55	CH2CH2CH2	ರ್.ಆ.ಆ.ಆ.ಆ.	₹	I	r	r	కో	Ø	Z.	ž

[0069]

[0070]

化合物	Œ	æ	æ	ď	æ	æ	4	×	>	金属
2-56	क्रुक	<b>9</b>	8	I	I	I	SO <sub>2</sub> CI	Ø	z	ż
2-57	CH200H20H20CH3	CH, OCH, CH, OCH,	<del>200</del>	I	I	I	ර්	s	z	Ż
2-58	CH2CH2NHCOCH3	CH2 CH2NHCOCH3	<del>2</del> 00	8 <del>2</del>	I	r	SOS	Ø	z	Ż
2-59	CH2CH2CCH(CH3)2	CHECHEOCHECH(CHS); CHECHEOCHECH(CHS);	퓽	H°OS	I	å	δ <sub>N</sub>	တ	z	Ż
2-60	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	₽о₹о	NHSO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	I	Ę	I	8	Ø	Z	7
2-61	Chotohon	GH2CH2CH2	₹	r	I	NHSO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	80 <sub>2</sub> 04 <sub>3</sub>	တ	z	Ž
2-62	ರ್ಷ-೧೯೮೪	ಯ್ದಿಯ್ಯರು <sub>ತ</sub>	₹	I	I	I	SCH, COOCH, CH,	ഗ	Z	Z
2-63	CHECHE SOUCHE	CHECHESOECHE	ቼ	SOCH.	I	I	CHN=NCH2CH3	ø	z	Co(2+)
- 6 7 8	CH <sup>2</sup> COCH <sup>2</sup> CH <sup>2</sup>	ರ್ <del>ಕ್ಷಂಯ</del> ಕ್ಕರಗ	₽	OCH CH	I	I	N(CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>	Ø	2	Z
2-65	Gr. Ch. OH	₽,40%	NHOOCH	I	I	NHCH <sub>3</sub>	9 F	Ø	z	<b>P</b>
5-66	CH2COOCH2CF2CHF2	CHE COOCH, CF, CHF,	동	ಯಂಗ್ಲಿಂದ್ನ	I	x	S T	Ø	z	Z
2-67	State State	No fo fo	₹	I	I	Ť	₹ ✓	Ø	2	Z
2-68	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	CH <sub>2</sub> CH=CH <sub>2</sub>	₹	Ι	I	0	0	Ø	Z	<b>5</b>
2-69	CH, CH, CH,	afafahah	₹	I	I	ਰੰ	фснуана	S	Z	Ź
2-70	0	ı	₹	r	I	I	COOCH <sub>3</sub>	S	z	72

化合物	Œ	a	B	R	æ	æ	4	×	>	×
7-71	<b>5</b>	ф. ф.	무	Ι	I	HEOSHN	F F	ေ	z	Co (3+1
2-72	<del>2</del> <del>2</del> <del>2</del> <del>2</del>	<b>%</b>	동	I	I	දිරු	) <del>1</del> 001 <u>¥</u> 001	Ø	z	Ž
k-73	R, と連結	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub>	용	I	I	r	NHSO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	Ø	z	Z
2-74	Rと連結	Re 上进结	₹	(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>	ı	(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub>	CALCHON,	ß	z	Z
2-75	R4七連結	Reと連結	퓽	CH <sub>2</sub> CCCH <sub>2</sub>	I	3000 Ho	귫	Ø	z	Ż
2-76	หือ <sup>2</sup> หอ	<del>10</del> 45	8	r	I	NHSO3H	C F	٥	z	Co(3+)
2-77	<b>%</b>	CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	8 F	Ř	I	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	) <sup>1</sup> 200 <del>1</del>	0	Z	Ž
2-78	R2 と連結	CH2 CH2 NHCOCH2	둉	I	I	I	NHSO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> O	٥	z	Z

【0071】また、記録特望などの改善のだめに、波長450~630nmに吸収極大を有し、520~690nmでの屈折率が大きい、前記以外の色素と混合してもよい。具体的には、シアニン系色素、スクアリリウム系色素、ナフトキノン系色素、アントラキノン系色素、ポルフィリン系色素、テトラピラポルフィラジン系色素、インドフェノール系色素、ピリリウム系色素、チオピリリウム系色素、アズレニウム系色素、トリフェニルメタン系色素、キサンテン系色素、インダンスレン系色素、インジゴ系色素、チオインジゴ系色素、メロシアニン系色素、ピスピロメテン系色素、チアジン系色素、アクリジン系色素、オキサジン系色素などがあるが、好ましく

N は、ポルフィリン系色素、シアニン系、ビスピロメテン 系色素であり、複数の色素の混合であってもよい。これ ちの色素の混合割合は、0.1~30%程度である。

【0072】記録層を成膜する際に、必要に応じて、前 記の色素に、クエンチャー、色素熱分解促進剤、紫外線 吸収剤、接着剤等の添加剤を混合か、あるいは、そのよ うな効果を有する基を置換基として導入することも可能 である。

【0073】なお、クエンチャーとしては、アセチルアセトナート系、ビスジチオーαージケトン系やビスフェニルジチオール系などのビスジチオール系、チオカテコール系、サリチルアルデヒドオキシム系、チオビスフェ

ノレート系等の金属錯体が好ましい。またアミン系も好 適である。

【0074】色素の熱分解促進剤としては、例えば、金 属系アンチノッキング剤、メタロセン化合物、アセチル アセトナト系金属錯体等の金属化合物が挙げられる。

【0075】さらに、必要に応じて、バインダー、レベリング剤、消泡剤等を併用することもできる。好ましいバインダーとしては、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ニトロセルロース、酢酸セルロース、ケトン樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、ウレタン樹脂、ポリビニルブチラール、ポリカーボネート、ポリオレフィン等が挙げられる。

【0076】また、色素層を基板の上に成膜する際に、 基板の耐溶剤性や反射率、記録感度等を向上させるため に、基板の上にあらかじめ無機物やポリマーからなる層 を設けても良い。

【0077】本発明において記録層としての、色素層における式(1)で表されるアゾ化合物またはその金属錯体の含有量は、30%以上、好ましくは60%以上である。尚、実質的に100%であることも好ましい。

【0078】色素層を設ける方法は、例えば、スピンコート法、スプレー法、キャスト法、浸漬法等の塗布法、スパッタ法、化学蒸着法、真空蒸着法等が挙げられるが、スピンコート法が簡便で好ましい。

【0079】ここでスピンコート法等の塗布法を用いる 場合には、式(1)で表されるアソ化合物またはその金 属錯体(以下色素ともいう)を1~40重量%、好まし くは3~30重量%となるように溶媒に溶解あるいは分 散させた塗布液を用いる。この際、溶媒は基板にダメー ジを与えないものを選ぶことが好ましい。例えば、メタ ノール、エタノール、イソプロピルアルコール、オクタ フルオロペンタノール、アリルアルコール、メチルセロ ソルプ、エチルセロソルプ、テトラフルオロプロパノー ル等のアルコール系溶媒;ヘキサン、ヘプタン、オクタ ン、デカン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、 エチルシクロヘキサン、ジメチルシクロヘキサン等の脂 肪族又は脂環式炭化水素系溶媒; トルエン、キシレン、 ベンゼン等の芳香族炭化水素系溶媒;四塩化炭素、クロ ロホルム、テトラクロロエタン、ジプロモエタン等のハ ロゲン化炭化水素系溶媒;ジエチルエーテル、ジプチル エーテル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサン等のエ ーテル系溶媒;アセトン、3-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブタノン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、乳酸メチル等 のエステル系溶媒、水などが挙げられる。これらは、単 独で用いてもよく、或いは、複数混合して用いてもよ

【0080】なお、必要に応じて、記録層の色素を高分子薄膜などに分散して用いたりすることもできる。また、基板にダメージを与えない溶媒を選択できない場合は、スパッタ法、化学蒸着法や真空蒸着法などが有効で

ある。

【0081】色素層の膜厚は、特に限定するものではな いが、好ましくは50~300nmである。色素層の膜 厚を50nmよりあまり薄くすると、熱拡散が大きいた め記録出来ないか、記録信号に歪みが発生する上、信号 振幅が小さくなる。また、膜厚が300nmよりあまり 厚い場合は反射率が低下し、再生信号特性が悪化する。 【0082】次に記録層の上に、好ましくは、厚さ50 ~300nmの反射層を形成する。反射層の材料として は、再生光の波長で反射率の十分高いもの、例えば、A u, Al, Ag, Cu, Ti, Cr, Ni, Pt, T a、Cr及びPdの金属を単独あるいは合金にして用い ることが可能である。この中でもAu、Al、Agは反 射率が高く反射層の材料として適している。これ以外で も下記のものを含んでいてもよい。例えば、Mg、S e、Hf、V、Nb、Ru、W、Mn、Re、Fe、C o, Rh, Ir, Cu, Zn, Cd, Ga, In, S i、Ge、Te、Pb、Po、Sn、Biなどの金属及 び半金属を挙げることができる。また、Auを主成分と しているものは反射率の高い反射層が容易に得られるた め好適である。ここで主成分とは含有率が50%以上の ものをいう。金属以外の材料で低屈折率薄膜と高屈折率 薄膜を交互に積み重ねて多層膜を形成し、反射層として 用いることも可能である。

【0083】反射層を形成する方法としては、例えば、スパッタ法、イオンプレーテイング法、化学蒸着法、真空蒸着法等が挙げられる。また、基板の上や反射層の下に反射率の向上、記録特性の改善、密着性の向上等のために公知の無機系または有機系の中間層、接着層を設けることもできる。

【0084】さらに、反射層の上の保護層の材料として は、反射層を外力から保護するものであれば特に限定し ない。有機物質としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹 脂、電子線硬化性樹脂、UV硬化性樹脂等を挙げること ができる。また、無機物質としては、SiO2、SiN 4、MgF<sub>2</sub>、SnO<sub>2</sub>等が挙げられる。熱可塑性樹 脂、熱硬化性樹脂などは適当な溶剤に溶解して塗布液を 途布し、乾燥することによって形成することができる。 UV硬化性樹脂は、そのままもしくは適当な溶剤に溶解 して塗布液を調製した後にこの塗布液を塗布し、UV光 を照射して硬化させることによって形成することができ る。UV硬化性樹脂としては、例えば、ウレタンアクリ レート、エポキシアクリレート、ポリエステルアクリレ ートなどのアクリレート樹脂を用いることができる。こ れらの材料は単独であるいは混合して用いてもよいし、 1層だけでなく多層膜にして用いてもよい。

【0085】保護層の形成の方法としては、記録層と同様にスピンコート法やキャスト法などの塗布法やスパッタ法や化学蒸着法等の方法が用いられるが、この中でもスピンコート法が好ましい。

【0086】保護層の膜厚は、一般には $0.1\sim100$   $\mu$  mの範囲であるが、本発明においては、 $3\sim30$   $\mu$  m であり、好ましくは $5\sim20$   $\mu$  mがより好ましい。

【0087】保護層の上に更にレーベル等の印刷を行うこともできる。

【0088】また、反射層面に保護シートまたは基板を 貼り合わせる、あるいは反射層面相互を内側とし対向さ せ光記録媒体2枚を貼り合わせる等の手段を用いてもよ い。基板鏡面側に、表面保護やゴミ等の付着防止のため に紫外線硬化樹脂、無機系薄膜等を成膜してもよい。

【0089】かくして形成された本発明の光記録媒体は、波長520~690nmの範囲から選択されるレーザー光に対して、基板側から測定した反射率が20%以上であることが好ましい。

【0090】本発明でいう波長520~690nmのレーザーは、特に限定はないが、例えば、可視領域の広範囲で波長選択のできる色素レーザーや、波長633nmのヘリウムネオンレーザー、最近開発されている波長680、650、635nm付近の高出力半導体レーザー、波長532nmの高調波変換YAGレーザーなどが挙げられる。本発明では、これらから選択される一波長または複数波長において高密度記録及び再生が可能となる。

#### [0091]

【実施例】以下に本発明の実施例を示すが、本発明はこれによりなんら限定されるものではない。

[実施例1]式(1)で表されるアゾ化合物のうち、

(表 1 1) に記載された化合物 (2-49) 0.2 g を2,2,3,3-テトラフルオロ-1- プロパノール (東京化成品) 10 m 1 に溶解し、色素溶液を調製した。基板は、ポリカーボネート樹脂製で連続した案内溝 (トラックピッチ:0.8  $\mu$  m) を有する直径120 m m  $\phi$ 、厚さ1.2 m mの円盤状のものを用いた。

【0092】この基板上に色素溶液を回転数1500rpmでスピンコートし、70℃3時間乾燥して、記録層を形成した。この記録層の吸収極大は540nmであり、光学定数は、680nmではnが2.1、kは0.04であり、650nmではnが2.2、kは0.05であり、635nmではnが2.3、kは0.07である。

【0094】さらに反射層の上に紫外線硬化樹脂SD-17 (大日本インキ化学工業製)をスピンコートした 後、紫外線照射して厚さ6μmの保護層を形成し、光記 録媒体を作製した。 【0095】得られた光記録媒体に、波長635nmでレンズの開口数が0.6の半導体レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて、線速度3.5m/s、レーザーパワー8mWで最短ピット長0.44μmになるように記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッド(レンズの開口数は0.6)を搭載した評価装置を用いて信号を再生し、反射率、エラーレート及び変調度を測定した結果、いずれも良好な値を示した。

【0096】次に680nm半導体レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて、線速度1.4m/s、レーザーパワー10mWで最短ピット長0.60μmになるように記録した。この記録した媒体を680nm、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)を用いて信号を再生し、反射率、エラーレート及び変調度を測定した。いずれも良好な値を示した。

【0097】このように、この媒体は複数のレーザー波 長で記録及び再生を良好に行うことが出来た。なお、エ ラーレートはケンウッド社製CDデコーダー(DR35 52)を用いて計測し、変調度は以下の式により求め た。

変調度= { (信号の最大強度) - (信号の最小強度) } / (信号の最大強度)

【0098】 [実施例2] 基板にポリカーボネート樹脂製で連続した案内溝(トラックピッチ:0.8 $\mu$ m)を有する直径120mm $\phi$ 、厚さ0.6mmの円盤状のものを用いる以外は実施例1と同様にして塗布及び反射層を形成した。

【0099】さらに反射層上に紫外線硬化性接着剤SD-301(大日本インキ化学工業製)をスピンコートし、その上にポリカーボネート樹脂製で直径120mm の、厚さ0.6mmの円盤状基板を乗せた後、紫外線照射して貼り合わせした光記録媒体を作製した。作製した媒体に、0.6mm厚に対応した635nm半導体レーザーヘッドを搭載している以外は実施例1と同様にパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載した評価装置を用いて信号を再生し、反射率、エラーレート及び変調度を測定した結果、いずれも良好な値を示した。

【0100】 [実施例3] 基板にポリカーボネート樹脂製で連続した案内溝(トラックピッチ:  $1.2\mu$ m)を有する直径 $120mm\phi$ 、厚さ0.6mmの円盤状のものを用いる以外は実施例2と同様にして光記録媒体を作製した。

【0101】作製した媒体に、0.6mm厚に対応した635nm半導体レーザーヘッドを搭載している以外は実施例1と同様にパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載した評価装置を用いて信号を再生し、反射率、エラーレート及び変調度を測定した結果、いずれも良好な値を示した。

【0102】 [実施例4] 基板にポリカーボネート樹脂製で連続した案内溝(トラックピッチ: $0.7\mu$ m)を有する直径 $120mm\phi$ 、厚さ0.6mmの円盤状のものを用いる以外は実施例2と同様にして光記録媒体を作製した。

【0103】作製した媒体に、0.6mm厚に対応した635nm半導体レーザーヘッドを搭載している以外は実施例1と同様にパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載した評価装置を用いて信号を再生し、反射率、エラーレート及び変調度を測定した結果、いずれも良好な値を示した。

【0104】 [実施例5~29] [表8]、〔表9]、 (表10] および [表12] に記載したアゾ化合物 (2-1~2-6[表8], 2-19~2-24 [表9], 2-33~2-35[ 表10], 2-57~2-66 [表12]) を用いる以外は、実施例2と同様にして光記録媒体を作製した。

【0105】作製した媒体に実施例1と同様に635nm半導体レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載した評価装置を用いて信号を再生し、反射率、エラーレート及び変調度を測定した結果、いずれも良好な値を示した。

【0106】 [実施例30] 〔表5〕 に記載したアゾ化合物 (1-65) と塗布溶媒としてジアセトンアルコール (東京化成品) を用い、基板にポリカーボネート樹脂製で連続した案内溝 (トラックピッチ:0.53μm)を有する直径120mmφ、厚さ0.6mmの円盤状のものを用いる以外は実施例2と同様にして光記録媒体を作製した。

【0107】この記録層の吸収極大は480nmであり、光学定数は、532nmではnが2.4、kは0.15である。

【0108】作製した媒体に、0.6mm厚に対応した532nmYAG高調波変換レーザーヘッドを搭載した光ディスク評価装置及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて、線速度3.8m/s、レーザーパワー7mWで記録した。記録後、同評価装置を用いて信号を再生した結果、反射率は約51%、エラーレートが7c

ps及び変調度が0.65であり、いずれも良好な値を示した。

【0109】 (実施例31~45) 〔表1〕、〔表2〕 および [表4] に記載したアゾ化合物 (1-1~1-3,1-18~1-22,1-39~45) を用いる以外は、実施例2と同様にして光記録媒体を作製した。

【0110】作製した媒体に実施例1と同様に635nm半導体レーザーヘッドを搭載したバルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載した評価装置を用いて信号を再生し、反射率、エラーレート及び変調度を測定した結果、いずれも良好な値を示した。

【0111】なお、〔表1〕~〔表13〕に記載されている他の化合物においても、635nmの波長で記録後、635nmおよび650nmの波長での再生において、良好な記録特性を示すことを確認した。

【0112】〔比較例1〕実施例2において、アゾ化合物(1-17)の代わりに、ベンタメチンシアニン色素NK-2929 [1,3,3,1',3',3'-ヘキサメチル-2',2'-(4,5,4',5'-ジベンゾ) インドジカルボシアニンパークロレート、日本感光色素研究所製]を用いること以外は同様にして光記録媒体を作製した。作製した媒体に実施例1と同様に635nm半導体レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて、先速3.5m/s、レーザーパワー7mWで記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載した評価装置を用いて信号を再生した結果、反射率は低く、エラーレートは大きく、変調度も小さかった。さらに、長時間再生していると信号が劣化した。

【0113】〔比較例2〕比較例1において、NK2929の代わりにトリメチンシアニン色素NK79[1,3,3,1',3',3'-ヘキサメチル-2',2'-インドジカルボシアニンアイオダイド、日本感光色素研究所製]を用いたこと以外は同様にして光記録媒体を作製した。作製した媒体に実施例1と同様に635nm半導体レーザーヘッドを搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWOOD製EFMエンコーダーを用いて、先速3.5m/s、レーザーパワー7mWで記録した。記録後、650nm及び635nm赤色半導体レーザーヘッドを搭載した評価装置を用いて信号を再生した結果、波形が歪み、エラーレートは大きく、変調度も小さかった。さらに、長時間再生していると信号が劣化した。

【0114】以上の実験例1~45および比較例1~2において、記録層の光学定数および各媒体を635nmで記録して、650及び635nmでの再生時の反射

率、エラーレート、変調度を〔表14〕~〔表19〕に 【0115】 【表14】 まとめて示す。

実施例	1	2	3	4	5	6	7	8
化学式助	2-49	2-49	2-49	2-49	2-1	2-2	2-3	2-4
吸収極大(na)	540	540	540	540	5 f D	510	520	520
光学定数								
850nm m#1	2. 2	2.2	2. 2	2.2	2.0	1.9	2.1	<b>2</b> . 0
k#2	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07
635nm n	2.5	2. 5	2. 5	2. \$	2.3	2. 3	2. 5	2. 4
ì	0.13	0.13	0.13	0.13	Q. DB	0.09	0.10	0.11
35nm記録								
550nm再生								
反射率(%)	60	61	53	58	59	56	57	55
17-1-1(cps)	В	7	5	8	9	10	10	12
変調度	0.10	0.71	0.75	0.65	0.54	0.63	0.65	0.63
\$ <b>\$</b> 5n <b>a</b> 再生								
反射率(%)	58	59	60	55	55.	5 \$	. 56	53
17-V-1 (eps)	6	6	5	8	g	å	9	8
変調度	D. 75	0.77	0.80	0.66	0.55	0.54	0.56	0.65

実施例	9	1 0	11	1 2	1 3	1 4	1 6	1 6
化学式No	2-5	2-6	2-19	2-20	2-21	2-22	2-23	2-24
吸収極大(nm)	530	530	530	\$30	510	520	520	520
光学定数								
650nm n#1	2. 1	1. L	2. 1	2.1	2.0	2. 1	2.1	2.0
1*2	0.09	0.09	0.11	0.10	0.06	0.09	0.11	0.09
635na n	2.4	2.5	2. \$	2.4	2.5	2. 4	2.4	2.4
k	0.12	0.13	0.18	0.15	0.10	0.12	0.12	0.11
535nm記錄								
650nn再生								
反射率(%)	56	5 5	51	52	51	53	\$1	53
17-V-1(cps)	9	9	10	9	g	10	9	11
変調度	0.55	0.64	0.50	9. 63	0.58	0.63	0.62	0.63
685no再生								
反射率(%)	54	59	60	54	\$ \$	\$4	53	55
17-6-1 (cps)	8	7	5	10	9	8	9	10
変調度	0.66	0.41	0.62	0. 65	0.62	0.65	0.65	0. 54

[0117]

#1 n; 屈折率 #2 k;消责係数

【表16】

実施例	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	22.	2 3	2 4
化学式 Bo	Z-13	2-34	2-35	2-57	2-58	2-59	2-60	2-61
吸収極大(nm)	530	520	530	\$50	540	550	555	535
光学定数								
650nm n#1	2. 1	2.0	2.1	2.2	2.0	2.1	2. 1	2.0
k#2	0.10	0.09	0.11	0.12	0.06	0.11	0.11	0.07
635nm n	2.4	2.4	2.4	2.6	2.5	2.5	2. 4	2. 5
k	0,17	0.11	0.12	0.14	0.10	0.13	0.15	0.10
535nn記録								
650nn再生								
反射率(%)	56	57	53	5.8	59	58	59	60
1j-1-1(cps)	10	11	12	9	9	10	10	11
変調度	0.60	D. 58	0.60	0.67	0.68	0.67	D. 66	0.65
635nm再生								
反射率(%)	54	55	\$5	57	58	57	57	51
17-1-1 (cps)	12	11	13	9	8	9	8	8
変調度	0.63	0.62	0.64	0.12	0.70	0.71	D. 69	0.69

#1 n; 屈折率 #2 k;消衰係数

[0118]

【表17】

実施例	2 5	2 6	27.	2 8	2 9	3 1	3 2	3 3
化学式No	2-62	2-63	2-64	2-85	2-66	1-1	1-2	1-3
吸収極大(n□)	540	545	585	540	550	465	470	460
光学定数								
850nm n*1	2. 1	2. 0	2. 0	2.0	2. l	1.9	1.9	1.8
k * 2	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.05	0.05	D. 04
635nm n	2.4	2. 5	2. 4	2. 4	2.5	2.1	2.1	2.0
k	0.12	0.13	0.11	0.12	Q. 13	0.08	g. 07	0.01
35nm記錄								
650nm再生								
反射率(%)	60	59	61	56	59	46	4.5	45
17-1-1 (cps)	8	8	7	8	8	14	15	14
変調度	0.67	0.68	0.68	0.65	0.66	0.55	0.56	0.5
635mm再生								
反射率(%)	56	57	59	57	59	47	46	48
17-1-1(cps)	6	7	5	7	8	14	13	12
変割度	0.70	0.71	0.69	0.68	0.68	0.58	0.58	0.58

【表18】 

実施例	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1
化学式No	1-18	1-19	1-20	1-21	1-22	1-39	1-40	1-41
吸収極大(nm	1) 470	475	465	455	470	480	485	460
光学定数								
650nm n#1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	<b>2.</b> 0	2. 0	1. 9
k # 2	0.05	0.06	0.05	0.08	0.05	0.07	0.08	0.07
635na n	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2. 1	2.1	2. 0
k	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08
i35nu記録								
650n#再生								
反射率(%)	46	45	49	11	49	52	51	19
17-V-F(eps	) 13	14	1\$	13	15	12	11	10
変調度	0.51	0.53	0.54	0.54	0.54	0.60	0.64	0.59
535ma再生					-			
反射率(%)	48	48	50	50	50	5 3	\$ 2	51
17-1-1 (cps	) 12	14	13	15	14	10	. 10	10
変調度	0.55	0.57	0.56	0.56	0.55	0.66	0.57	0.64

\*1 n; 屈折率 \*2 k;消衰係数

[0120]

【表19】

実施例	4 2	4 3	4 4	4 5	比較例	1	2
化学式Ho	1-42	1-44	1-44	1-45		NK2929	NK79
吸収極大(111	470	475	465	465		640	\$50
光学定数							
650nm n#1	1. 8	1.8	1.8	1.8		1.9	2.1
k + 2	0.05	0.06	0.05	0.06		1.15	0.08
635nm n	2. 1	2. 0	2.0	<b>2</b> . 0		1.8	2.3
k	0.07	0.08	0.07	0.07		1. \$0	0.10
35nn記録							
650nm再生							
反射率(%)			50	50		9	\$ 8
1j-v-\(cps)			9	10		3000	550
変調度	0.68	0.59	0.60	0.62		0.13	0.85
635nm再生							
反射率(%)	54	53	52	5 2		9.	60
17-1-1(cps)	9	9	9	8		2500	350
変調度	0.67	0.64	D_ 66	0.66		0.15	0. 38

#### #1 n; 屈折率 #2 k;消衰係数

#### [0121]

【発明の効果】本発明によれば、特定の骨格のアゾ色素で、適当な吸収波長と光学定数(屈折率と消衰係数)を有するものを記録層とすることにより、波長520~690nmのレーザーでの良好な高密度記録及び再生が可能な追記型光記録媒体を提供できる。

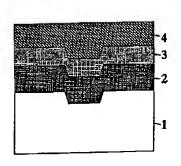
#### 【図面の簡単な説明】

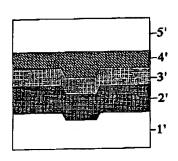
【図1】従来の光記録媒体及び本発明の層構成を示す断 面構造図

【図2】本発明の光記録媒体の層構成を示す断面構造図

## 【符号の説明】

- 1 基板
- 2 記録層
- 3 反射層
- 4 保護層
- 1' 基板
- 2' 記録層
- 3' 反射層
- 4'接着層
- 5' 基板





## フロントページの続き

(72) 発明者 杉本 賢一

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内

(72)発明者 西本 泰三

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内

(72) 発明者 津田 武

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内

(72)発明者 詫摩 啓輔

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内

(72)発明者 広瀬 純夫

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内